課題番号：JPMXP1223OS ←当拠点で記入します

先端機器室管理の装置の利用申請について

ナノテクノロジープラットフォーム事業で供用されていた以下の装置についてはマテリアル先端リサーチインフラ事業開始に伴い、産業科学研究所ナノテクノロジーセンター先端機器室に移管されました。これらの装置の利用を希望する場合は、本申請書（別紙）を追加でご提出ください。

なお利用時には「大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点利用規程（ARIM微細加工プラットフォーム、ARIM合成プラットフォーム）」、「大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点課金規程（ARIM微細加工プラットフォーム、ARIM合成プラットフォーム）」が適用されます。

**課題申請者氏名：**

機器利用料(単価：円／時間、消費税込)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用したい装置に〇印 |  | 装置名 | 機器利用料金 | |
| 大学・公的研究機関 | 民間企業等 |
| × | S02 | SIMS付きカウフマン型イオンミリング装置 | 5,000 | 7,500 |
| × | S37 | イオン化ポテンシャル測定装置 | 2,500 | 3,750 |
| × | S38 | 電流密度測定装置 | 1,600 | 2,400 |

装置番号S02（SIMS付きカウフマン型イオンミリング装置）は産業科学研究所N415クリーンルーム内に設置されておりますので、別途クリーンルーム入室料が必要です。

同一日にS02に加えてN415室内のマテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点の他の装置を使用する場合は、重複してクリーンルーム入室料は課されません。

クリーンルーム入室料（消費税込、所属区分や成果公開区分によらず同額）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 課金対象となる部屋 | 円／日・人 | 備考 |
| N415室 | 500 | 上限5,000円／月 |

技術支援料(単価：円／時間、消費税込)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支援内容 | 技術支援料 | |
| 大学・公的研究機関 | 民間企業等 |
| 技術代行 |  |  |
| 技術補助・オペレーショントレーニング | 1,000 | 1,500 |

先端機器室では技術代行は実施しておりません。